MANUFACTURING METHOD FOR MEASURING APPARATUS AND MEASURING APPARATUS MANUFACTURED BY THE MANUFACTURING METHOD

Patent number:

JP10185864

Publication date:

1998-07-14

Inventor:

SIEBEN ULRICH; WOLF BERNHARD; HABERLAND

HELLMUT; CREMER CHRISTOPH DR

Applicant:

- european:

ITT IND GMBH DEUTSCHE

Classification: - international:

G01N33/543

G01N27/414; G01N27/403; (IPC1-7): G01N27/414; G01N27/414

Application number: JP19970003629 19970113 Priority number(s): DE19961001488 19960117 Also published as:

EP0785424 (A1) US6033916 (A1)

EP0785424 (B1)

DE19601488 (C1)

Report a data error here

Abstract of JP10185864

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the mechanical fixation of an organismic component to an active contact face at a sensor and to enhance the signal transfer characteristic and the measuring sensitivity, by structuring the active contact face at the sensor so as to agree nearly with the contour shape on the outer side of the organismic component. SOLUTION: A field-effect transistor 9, which reacts sensitively to the electric field of an FET sensor 5 comprises a silicon substrate 21, and heavily doped regions 22, 23, for a source and a drain, whose conductivity type is opposite to that of the substrate are diffused into the substrate. A cultivation liquid 10 as one drop exists on a silicon oxide layer 12 together with a cell 11 contained in it. The cell 11 is provided with many receptors 13 on its outer film, and messenger substrates 14 which correspond to the receptors 13 float in the cultivation liquid 10. Then, an active contact face 24 at the sensor 5 is structured so as to agree nearly with the contour shape on the

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list 7 family members for: JP10185864 Derived from 6 applications.

ABack to JP 10 185864

- Measuring device manufacturing method for measuring or testing physiological parameter at biocomponent Publication info: DE19601488 C1 - 1997-05-28
- 2 No English title available Publication info: **DE59703324D D1** - 2001-05-17
- Method for making a measuring device and measuring device made by this method

Publication info: **EP0785424 A1** - 1997-07-23 EP0785424 B1 - 2001-04-11

MANUFACTURING METHOD FOR MEASURING APPARATUS AND MEASURING APPARATUS MANUFACTURED BY THE MANUFACTURING METHOD

Publication info: **JP10185864 A** - 1998-07-14

- Measuring device and method for making same Publication info: **US6033916 A** - 2000-03-07
- Measuring device and method for making same Publication info: **US6210977 B1** - 2001-04-03

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出國公開番号 特開平10-185864

(43)公開日 平成10年(1998)7月14日

(51) Int.CL.4 G01N 27/414 33/543

識別記号

593

PΙ

G01N 27/30 33/543 301N 593

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 5 頁)

(21)出賦番号

特里平9-3629

(22)出版日

平成9年(1997)1月13日

(31)優先権主張番号 19601488.3

(32)優先日

1996年1月17日

(33) 優先推主張団

ドイツ (DE)

(71)出版人 591064140

ドイチェ・アイティーティー・インダスト リーズ・ゲゼルシャフト・ミト・ペシュレ ンクタ・ハフツンク DEUTSCHE ITT INDUST RIES GESELLSCHAFT M IT BESCHRANKTER HAF TUNG

ドイツ連邦共和国 フライブルク ハンス ープンテーシュトラーセ 19

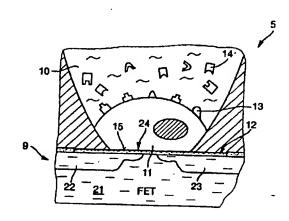
(74)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外3名)

最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 初定装置の製造方法並びにその製造方法により製造された例定装置

(57)【要約】

【課題】 センサの活性の接触面上への生体成分(細 胞、レセプター、ガンマーグロブリン)の機械的に定着 を高め、さらに信号転送特性及び測定感度を改善する 【解決手段】 生体成分に対して活性の接触面 (24) を備えた測定構造体を有する少なくとも1個のセンサ (5)を備えた生体成分の生理学的パラメータを測定又 は検査するための測定装置の製造方法において、センサ (5)の活性の接触面(24)がそれぞれの生体成分の 外側の輪郭形状にほぼ一致するように構造化することを 特徴とする測定装置の製造方法



9/17

【特許請求の範囲】

【請求項1】 生体成分に対して活性の接触面(24) を備えた測定構造体を有する少なくとも1個のセンサ (5)を備えた生体成分の生理学的パラメータを測定又 は検査するための測定装置の製造方法において、センサ

(5)の活性の接触面(24)がそれぞれの生体成分の 外側の輪郭形状にほぼ一致するように構造化することを 特徴とする測定装置の製造方法。

【請求項2】 センサ(5)の活性の接触面(24)上 け、このクラスター被覆(15)を引き続き酸化し、温 度処理する、請求項1記載の方法。

【請求項3】 センサ (5) の活性の接触面 (24) 上 にクラスター(16)の形成のためのアルミニウムから なる材料粒子を撃ち付ける、請求項2記載の方法。

【請求項4】 センサ(5)の活性の接触面(24)上 のクラスターが約5000個の原子から形成されている 請求項2又は3記載の方法。

【請求項5】 約5000個の原子からなるクラスター 助エネルギーで活性の接触面(24)上へ設置し、この クラスター被覆を引き続き酸化させ、温度処理する請求 項2記載の方法。

【請求項6】 生体成分の形状が付与され、接触面被覆 (15)を、複製技術、特にブラズマ衝撃技術又はエッ チング技術を用いて生体成分の形状にほぼ一致する相補 的な対応構造を設置する請求項1から5までのいずれか 1項記載の方法。

【請求項7】 生体成分の形状が印刷技術で付与され る、請求項6記載の方法。

【請求項8】 間隙を備えた緻密でない構造を有する接 触面被覆(15)の形成のために、クラスター(16) の形成のための材料粒子を約1 e V/原子よりも小さい 運動エネルギーで、活性の接触面 (24) 上に撃ち付 け、このクラスター被覆を引き続き酸化し、温度処理す る、請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。 【請求項9】 クラスター(16)が約12000個の 原子から構成されている請求項8記載の方法。

【請求項10】 請求項1から9までのいずれか1項記 載の方法を実施するために、センサ(5)は生体成分に 40 対して活性の接触面(24)を備えた測定構造体を有 し、評価装置と接続可能な測定出力を有する少なくとも 1個のセンサ(5)を備えた生体成分の生理学的パラメ ータの測定又は検査のための測定装置において、センサ (5)の活性の接触面(24)は検査すべき生体成分に ほぼ適合する表面トポグラフィーを有することを特徴と する生体成分の生理学的パラメータの測定又は検査のた めの測定装置。

【請求項11】 センサ接触面(24)もしくは接触面 被覆(15)の表面トポグラフィーが、主として、それ 50 ぞれの生体成分の相補的な対応構造を有する、請求項1 0記載の測定装置。

【請求項12】 接触面被覆(15)が、生体成分又は その部分をはめ込むために、ほぼ接触面(24)にまで 延びるか又は接触面まで延びる間隙(17)を有する、 請求項10又は11記載の測定装置__

【請求項13】 センサが、酸化アルミニウム、窒化ケ イ索又は同等の構造化材料からなる接触面(24)の被 覆(15)を備えた電界効果トランジスタ(9)を有す ヘクラスター(16)の形成のための材料粒子を撃ち付 10 る、請求項10から12までのいずれか1項記載の測定 装置。

> 【請求項14】 センサ(5)の接触面(24)もしく はその被覆(15)がナノメータ範囲の粗面性を有して いる、請求項10から13までのいずれか1項記載の測 定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、生体成分に対して 活性の接触面を備えた測定構造体を有する少なくとも1 (16)の形成のために材料粒子を約1eV/原子の運 20 個のセンサを有する生体成分の生理学的パラメータの測 定又は検査のための測定装置の製造方法に関する。さら に、本発明の前記方法により製造された測定装置にも関 する.

[0002]

【従来の技術】特に多種多様な細胞のマイクロシステム (zellulaere Mikrosysteme) は次第に重要になってき ている。生物学的マイクロシステムと物理学的トランス デューサーとの組合せは、生物学的システムの一次信号 応答を、問題なく記録及び加工するととができる電気的 30 信号に変換することができる。

【0003】全てのセンサは、生きた細胞又はその成分 (レセプター、ガンマーグロブリン) によってシステム の一次的センサー機能が担われ、そのアウトブット信号 は多様な物理的トランスデューサーを用いて受け取られ るととは共通している。

【0004】センサの開発及び確認試験の際に、全ての 細胞タイプもしくは生体成分が、トランスデューサー表 面と同じように良好な接触を作り出せないことが示され ている。確かに、多くの場合、培養条件の選択によりバ ッチ方法に対して良好な付着を達成することに成功して いるが、複動注入装入(Fliessinjektionseinsaetze) のための条件は全ての細胞又は同等のものにとって保証 するととはできない。特に、根元的に腫瘍細胞から由来 しない動物細胞系統のような細胞はとの場合、問題が多 b.

【0005】さらに、FETベースの免疫センサの場合 に、より良好な信号応答を得るために、使用した抗体の 最適な固定化が反応性のエピトーブの位置合わせを必要 とするという問題が生じる。

【0006】FETベースのバイオセンサは米国特許

(US) 第4777019号明編書から公知である。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、セン サの活性の接触面上への生体成分(細胞、レセプター、 ガンマーグロブリン) の機械的な定着を高め、さらに信 号転送特性及び測定感度を改善することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記の課題は、本発明に より、センサの活性の接触面をそれぞれの生体成分の外 側の輪郭形状にほぼ一致するように構造化することによ 10 り解決される。活性の接触面のとの構造化により、それ 自体ナノメータ範囲内の構造化効果を有するトポグラフ ィー(Topographie)を示す生体成分(細胞、生体分 子、細胞部分等)を本質的により安定に接触面上に定着 させ、その結果、特に良好な長時間安定性が得られ、か つ生きた細胞又は同等のものを有するセンサは長時間に わたり運転可能に保持することができる。

[0009]生体成分の形状を付与される場合、及び接 触面被覆に複製技術、特にブラズマ衝撃技術又はエッチ 的な対応構造を備えさせる場合が特に有利である。との 場合、生体成分の形状は印刷技術(Abdrucktechnik)で 付与するととが有利である。

【0010】従って、堆積させるための生物系又は生体 成分のトポグラフィーに表面構造もしくは輪郭を直接的 に適合させることが行われ、それにより特に良好な定着 を保証する。生体成分のトポグラフィーを活性の接触面 上に転写することは、公知の複製技術で行うことができ

[0011]との方法の実施態様は、間隙を有する緻密 30 でない構造を備えた接触面被覆の形成のために、クラス ターの形成のための材料粒子を、約1eV/原子よりも 小さい運動エネルギーで活性の接触面上へ撃ち付けると とが考慮される。

【0012】この場合、クラスターは有利に約1200 0 個の原子から形成される。それにより、定着層がセン サの接触面上に構築され、この層は比較的緻密でなく多 孔性の構造を有する。 その際、間隙もしくは穴が形成さ れ、との間隙もしくは穴の中に例えば免疫レセプターを 定着させることができる。このかみ合いによりこの生体 40 成分は著しく良好に定着され、それによりセンサは著し く良好な長時間安定性を有する。同時に、生体成分とセ ンサ接触面との間の間隔を最小に低減し、従ってセンサ に影響を及ぼす電荷移送現象(Ladungstransfer-Vorgan g) がセンサーのより近くで進行するために、本質的に より大きな測定感度も達成することができる。

[00]3]本発明による方法により製造された測定装 置は、センサの活性の接触面が、検査すべき生体成分の 形状にほぼ適合する表面トポグラフィーを有することを

それぞれの生体成分の相補的な対応構造を有する場合が 特に有利である。

【0014】それにより既にセンサ製造方法に関して記 載された利点が生じる。

【0015】とのセンサが酸化アルミニウム、窒化ケイ 紫又は同様の構造化材料からなる電界効果トランジスタ を有する場合が有利である。

【0018】着しく平坦な酸化ケイ素からなる接触面に 対して、酸化アルミニウム又は窒化ケイ素は、生体成分 の構造に適合した粗面化された表面を創り出すととが可 能であるという利点を有する。

【0017】酸化アルミニウムは高いpH感度を示し及 び生理的信号に対して高い感度を示し、細胞又はその同 等の生体成分の電界効果トランジスタへの電気的カブリ ングは改善され、それによりアウトブット信号が高めら れる。

【0018】窒化ケイ素は高い電圧感度を示す。 [0019]

【実施例】本発明の他の実施態様は他の従属形式請求項 ング技術を用いて生体成分の形状にほぼ一致する、相補 20 に記載されている。次に本発明を図面によりその詳細を さらに詳説する。

【0020】図1は、多様なセンサを有する生物医学的 センサシステムの略図を表す。

[0021] 図2は、FETセンサの略図を表す。

【0022】図3は、被覆及び設置された免疫レセブタ を有するFETセンサの略図を表す。

【0023】図1に示された生物医学的センサシステム 1は、検査すべき細胞の収容のための小型化された室2 を有し、との機能は、多数の散在するセンサにより問い 合わされる。とのセンサはセンサ起動部及び信号前処理 装置3と接続されており、との信号前処理装置は、測定 データ収集及び評価のため並びに測定経過制御及び温度 調節のためのコンピュータ4と接続されている。

【0024】図示された実施例において、電界効果トラ ンジスター構造体を有するセンサ5の他に、光学センサ 5 a、酸素センサ5 b、温度センサ5 c並びに細胞電位 **測定のためのセンサ5 dを用いて、インビーダンス測定** のため**の**交互に配置した構造体5 e及びさらに外部のセ ンサ5 fが用いられる。センサシステム1の観察領域6 において、なお1つの顕微鏡7が示されている。8化よ り媒体、試験物質、ポンプ等のための機能ブロックが示 されている。との機能ブロック並びにセンサもセンサ起 動部及び信号前処理装置3と接続している。これらのマ イクロセンサは多様な形状を有しているが、生きた細胞 がそのすぐ周囲に存在するか、又はこの細胞がマイクロ センサの統合された構成部分であるように常に構成され る.

【0025】図2は1個のFET-センサ5が示されて おり、これは電場に関して着しく敏感に反応する電界効 特徴とする。センサ接触面の表面トポグラフィーが主に 50 果トランジスタ9を有している。この電界効果トランジ . スタ9は1つのケイ素基板21を有しており、その中へ 基板とは反対の伝導タイプを有するドレイン及びソース のための高度にドーピングされた区域22.23が拡散 されている。その上方に誘電体として散化ケイ素層12 が存在し、これは外側で活性のセンサ接触圏を形成し、 その層を介してFETが制御可能である。

5

【0026】酸化ケイ素からなる層12上には1滴の培養液10がその中に含まれる細胞11と共に存在する。各細胞11はその外皮上に多数のレセプタ13を有している。培養液10中にはレセプターに対応するメッセンジャー物質はそれぞれの対応するレセプターで細胞に定着することができる。この定着は、分子的結合を変化させ、電気的荷電をシフトさせることになる。それにより引き起こされる電気的バラメータの変化が、電界効果トランジスタ9により感知され、電気的信号の形に変換される。それにより、生物学的信号伝達から電気的信号伝達になる。この電気的信号伝達は、次いで問題なく増幅され、電気的に読み取られ、診断の目的でさらに加工することができる。

【0027】酸化ケイ素層12がセンサ5の活性の接触 面2.4として僅かに構造化されているにすぎないため、 全ての細胞は長時間にわたりこの酸化ケイ素層上に付着 しない。従って、FET-センサの活性の接触面24は 構造化され、それにより細胞の外側の構造に適合するよ うに設計されている。この細胞自体はもちろん比較的着 しく構造化されており、多くのくぼみ及び突起を有して いる。活性の接触面24の外側の構造の明確化のため に、これを図3において著しく拡大して示し、ととでは センサ5の活性の接触面の被覆15が確認できる。この 30 被覆は堆積された酸化アルミニウム-クラスター16か らなり、とのクラスターは丸い円により示されている。 とのようなクラスターは真空中での強力な放射により製 造することができる。このクラスターを表面に撃ち付け る場合、放射のエネルギーに応じてこの表面の多様な構 造が生じる。小さなエネルギー(原子あたり0.1e V)の場合には、中空空間を有する粗面の、多孔性の層 が生じる。租面性及び表面構造はクラスターの運動エネ ルギーにより変えることができる。約10eV/原子か らは著しく平滑な層が達成される。ほぼ1eV/原子で 40 はナノメータ範囲の適当な粗面性が生じる。

【0028】 このクラスターは複合体を形成し、この構造は特にクラスターが電界効果トランジスタ9の誘電性 圏12上へ適用されるエネルギーに依存している。既に前記したように、撃ち付けられるクラスターの運動エネルギーが約1eV/原子である場合に細胞の定着のために適した粗面性が生じることが試験により示されている。この場合約5000個の原子がそれぞれ1つのクラスターにまとまっており、その際、各クラスターはほぼ10ナノメータの直径を有する。

【0029】しかしながら、クラスターあたり約12000個の原子を有しかつ比較的僅かな運動エネルギーを有する比較的大きなアルミニウムクラスターをFET層12にドーピングすることも可能である。

【0030】撃ち付けられたクラスター16は次いで酸化され温度処理され、多孔性であるが硬質の酸化アルミニウム層にされる。この酸化アルミニウム層は多様な技術(プラズマ衝撃技術(Plasmabeschusstechnik)、エッチング技術)を用いて亀製及び間隙17を生じるように加工することができる。

【0031】こうして製造された約10nmの直径を有することができる穴中へ特に良好に例えば免疫レセプター18(ガンマーグロブリン、Y型の生体分子)が、図3に示されているように直接定着される。細胞の中間機能自体が排除されているので、FETに影響を及ぼす電荷移送現象がFET上ではるかに近くで進行するため、本質的により高い電気的信号が期待される。それにより、測定感度は相応して改善されている。構造化材料として、酸化アルミニウムの他に、特に窒化ケイ素も使用であるとができる。各々使用される構造化材料は、各々の測定方法に対して関連した要求に依存する。高められた電圧感度が必要とされる場合に窒化ケイ素が使用され、pH-感度に関して必要性が高い場合には酸化アルミニウムが使用される。

【0032】免疫レセプター18はY型の生体分子(Bi omolekuele)により形成され、通常は細胞壁中にはめ込まれる保持領域19により多孔性のセラミック構造体中へ直接はまり込んでおり、それにより、この免疫レセプターは良好に定着されており、このセンサは全体で著しく良好な長時間安定性を有する。免疫レセプター18の感覚的に敏感な両方の末緯20は被覆15から外側に突き出している。

【0033】被覆15中での免疫レセプター18の定着は、引き続く洗浄工程を伴う沈降法(Sedimentationsve rfahren)により行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】多様なセンサを有する生物医学的センサシステ ムの略図

【図2】FETセンサの略図

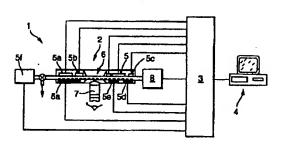
「図3」被覆及び設置された免疫レセブタを有するFE Tセンサの略図

【符号の説明】

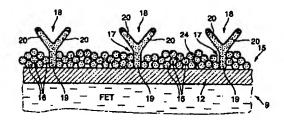
1 生物医学的センサシステム、 2 室、 3 信号 前処理装置、 4 コンピュータ、 5 センサ、 観察領域、 7 顕微鏡、 機能ブロック、 8 電界効果トランジスタ、 10 培養液、 11 12 酸化ケイ素層、 13 レセプター、 4 メッセンジャー物質、 15 接触面被覆、 16 クラスター、 17 間隙、 18 免疫レセブタ 19保持領域、 20 末端、 21 ケイ素基

22,23 区域、 24活性の接触面

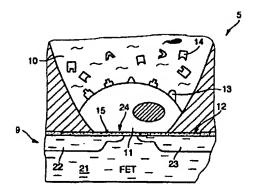
[図1]



【図3】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 ウルリッヒ ズィーベン ドイツ連邦共和国 ロイテ クローネンガ

ッセ 7

(72)発明者 ベルンハルト ヴォルフ ドイツ連邦共和国 シュテーゲン アンド レアスシュトラーセ 12

(72)発明者 ヘルムート ハーバーラント

ドイツ連邦共和国 ベッツィンゲン ライ レンヴェーク 17アー

(72)発明者 クリストフ クレーマー

ドイツ連邦共和国 ハイデルベルク モン バッハブラッツ 23